

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年10月6日 (06.10.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/093394 A1

(51)国際特許分類7: G01N 21/71
(21)国際出願番号: PCT/JP2005/005471
(22)国際出願日: 2005年3月25日 (25.03.2005)
(25)国際出願の言語: 日本語
(26)国際公開の言語: 日本語
(30)優先権データ:
特願2004-127380 2004年3月25日 (25.03.2004) JP
特願2004-253664 2004年8月31日 (31.08.2004) JP
(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 (JAPAN)
(72)発明者; および
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 高村 梓 (TAKAMURA, Yuzuru), 飯塚 亜紀子 (IIDUKA, Akiko), 民谷 実一 (TAMIYA, Eiichi).
(74)代理人: 細田 芳徳 (HOSODA, Yoshinori); 〒5406591 大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル5階私書箱26号 細田国際特許事務所内 Osaka (JP).

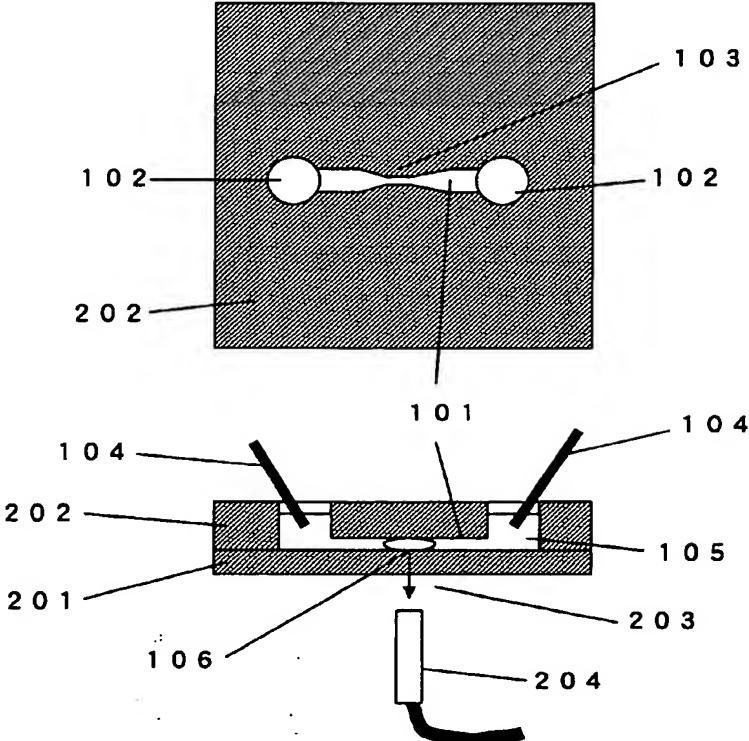
[統葉有]

(54) Title: PLASMA GENERATING EQUIPMENT

(54)発明の名称: プラズマ発生装置



WO 2005/093394 A1



も著しく小さい断面積を有する狭小部を設け、該流路および狭小部に導電性液体を満たした後、前記狭小部に電界が通過するよう

(57) Abstract: A plasma generating method and an elemental analysis method are provided. In the methods, a small narrow part having a cross-section area remarkably smaller than a cross-section area of a flow path formed of an insulating material is provided in the flow path, then, after filling the flow path and the small narrow part with a conductive liquid, an electric field is applied on the small narrow part so as to have the electric field pass through the small narrow part, and plasma is generated at the small narrow part. The plasma generating equipment and an emission spectrophotometer provided with the plasma generating equipment are provided, wherein the small narrow part having the cross-section area remarkably smaller than the cross-section area of the flow path is arranged in the flow path formed of the insulating material, and a means for applying the electric field on the small narrow part is arranged on the small narrow part so as to have the electric field pass through the small and narrow part.

(57)要約: 絶縁性材料で形成された流路に該流路の断面積よりも著しく小さい断面積を有する狭小部を設け、該流路および狭小部に導電性液体を満たした後、前記狭小部に電界が通過するよう

[統葉有]

Best Available Copy